

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2008年02月29日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2006000016"/>	整理番号 <input type="text" value="10994"/>	担当者 <input type="text" value="加根魯 和宏"/>
表 題	レジストフィルムを用いた積層セラミック電子部品の製造方法		
技術分野	<input type="text" value="電気・電子"/>	<input type="text" value="情報・通信"/>	<input type="text" value="無機材料"/>
適用製品	<input type="text" value="積層セラミック製品"/>		
目 的	従来の積層セラミック電子部品の製造において、導体となる金属、また異種の材料をパターンとして形成し、また、同時に平坦な表面を得ることを目的とする。		
技術概要	従来の積層セラミック電子部品の製造においては、導体パターンをスクリーン印刷によって形成し、導体層間はレーザーによって穿孔穴を開け導体を充填することによって行っていた。スクリーン印刷を用いる場合、平坦なシートに対して印刷部分が盛り上がるのが特徴であり、またレーザー穿孔によれば光の減衰により極度のテーパ形状を残すことが特徴である。したがって微細化する場合これらが障害となっている。 本法においてはレジストフィルムを用いることにより、導体などの異種材料を極微細なパターンとして形成することができ、かつ平坦な表面を形成することができる。また、同様に層間連絡用のパターンもテーパを軽減して形成できる。		

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL: 03-5275-8139 FAX: 03-5275-8328 E-mail: nubic@nihon-u.ac.jp